

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- Раткин Л. С. К юбилею национального исследовательского центра "Курчатовский институт": новые разработки в сфере нано- и микросистемной техники № 2
- Раткин Л. С. Синхротронные и нейтронные исследования наносистем № 1

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

- Александров П. А., Бударягин В. В., Жук В. И., Литвинов В. Л. Об отказоустойчивости нанозлектронных интегральных схем при облучении № 1
- Баркалин В. В., Чашинский А. С. Адсорбция водорода углеродными нанотрубками с учетом взаимодействия в адсорбированной фазе № 2
- Воробьева А. И., Прищепа С. Л., Уткина Е. А., Комар О. М. Формирование и свойства никелевых наностолбиков в пористом оксиде алюминия № 1
- Галушка В. В., Биленко Д. И., Терин Д. В. Исследование управляемого массопереноса в наноструктурах AgI—Ag методом туннельной микроскопии № 8
- Глухова О. Е., Колесникова А. С., Сленченков М. М. Терагерцовый нанозондатель на основе нанотрубки с инкапсулированными фуллеренами № 10
- Самойлович М. И., Бовтун В., Белянин А. Ф., Кемпа М., Нужный Д., Клещева С. М., Савинов М. Диэлектрические свойства опаловых матриц с заполнением межсферических нанополостей оксидом цинка № 7
- Шешин Е. П., Колодяжный А. Ю., Обьедков А. М., Кетков С. Ю., Кремлев К. В., Каверин Б. С., Семенов Н. М. Исследование автоэмиссионных свойств массивов радиально-ориентированных многостенных углеродных нанотрубок № 10
- Яхьяева Х. Ш., Козлов Г. В., Магомедов Г. М. Зависимость уровня межфазной адгезии от радиуса кольцеобразных структур углеродных нанотрубок (нановолокон) № 8

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Абрамов И. И., Коломейцева Н. В., Лабунов В. А., Романова И. А., Басаев А. С. Моделирование функционально-интегрированных структур на основе углеродных нанотрубок № 5
- Амеличев В. В., Генералов С. С., Якухина А. В., Шаманаев С. В., Платонов В. В. Конструкция и технология изготовления матрицы силовых микроэлектромеханических ключей № 3
- Артемова А. И., Михайлов Ю. А., Панков В. В., Суханов В. С. Оптимизация конструкции чувствительного элемента давления с распределенным жестким центром с помощью компьютерного трехмерного моделирования № 7
- Афонин С. М. Решение волнового уравнения в задачах электромагнитоупругости для актюаторов нано- и микроперемещений № 2
- Винокуров Д. Л. Численное моделирование магнитной структуры компенсированной границы раздела ферромагнетик — мультиферроик № 4
- Вишнеков А. В., Ерохин В. В., Иванова Е. М. Автоматизация процедуры выбора микроконтроллера № 7
- Галперин В. А., Разживин Н. А. Исследование процесса контролируемого плазменного сокращения размеров затвора № 6
- Глухова О. Е., Колесникова А. С., Сленченков М. М., Шмыгин Д. С. Управление движением фосфолипидов во внешнем электрическом поле № 7
- Гридчин В. А., Васильев В. Ю., Чебанов М. А., Бялик А. Д., Чернов А. С. Численное моделирование элементов фотоэлектрического волоконно-оптического сенсора давления № 6
- Деспотули А. Л., Андреева А. В. Ток смещения Максвелла и "универсальный" динамический отклик в наноионике № 5
- Джашинов В. Э., Панкратов В. М., Голиков А. В. Математическое моделирование тепловых процессов в углеродных нанотрубках и фуллеренах № 11

- Зенченко Н. В., Рубан О. А., Алешин А. Н., Глинский И. А., Мельников А. А. Моделирование нестационарных тепловых режимов HEMT-транзистора № 12
- Игнатов И. И., Мосин О. В. Цветной коронный спектральный Кирлиан-анализ в моделировании неравновесных условий с газовым электрическим разрядом, имитирующих первичную атмосферу № 8
- Макаревич М. М. Исследование эффективности использования специализированной библиотечки мажоритарных элементов при автоматизации проектирования № 11
- Мальцев П. П., Матвеев О. С., Федоров Ю. В., Гнатюк Д. Л., Кранухин Д. В., Зуев А. В., Бунегина С. Л. Монолитная интегральная схема усилителя со встроенной антенной для пяти-миллиметрового диапазона длин волн № 9
- Маркелов А. С., Трушин В. Н., Чурунов Е. В. Исследование возможности формирования пространственной структуры рентгеновских пучков с использованием легированных кристаллов № 4
- Молодцова Г. В., Милованов Р. А., Zubov Д. Н., Кельм Е. А. Подходы к разделению кристаллов стекловых сборок при анализе отказов многокристалльных интегральных схем № 7
- Подгорный Ю. В., Воротилов К. А., Лавров П. П., Сигов А. С. Вольт-амперные характеристики пористых пленок ЦТС № 9
- Пронин И. А., Аверин И. А., Димитров Д. Ц., Карманов А. А. Особенности структурообразования и модели синтеза наноконструктивных материалов состава $\text{SiO}_2\text{—MxO}_y$, полученных с помощью золь-гель-технологии № 8
- Пронин И. А., Аверин И. А., Мошников В. А., Якушова Н. Д., Кузнецова М. В., Карманов А. А. Перколяционная модель газового сенсора на основе полупроводниковых оксидных наноматериалов с иерархической структурой пор № 9
- Росляков А. С. Исследование возможности создания низкочастотных СФ блоков для решения конечно-разностных уравнений в преобразованиях низкочастотных сигналов № 6
- Саногин В. Г., Прокопенко Н. Н., Марчук В. И., Манжула В. Г., Будяков А. С. Индуктивные свойства микроскопического проводящего кольца с плотностью вихревого тока азимутального направления № 1
- Сеничкин А. П., Бугаев А. С., Ячменев А. Э. Исследование токовой неустойчивости в образцах, содержащих нанопиты из атомов олова, встроенные в кристалл арсенида галлия № 3
- Сеничкин А. П., Бугаев А. С., Ячменев А. Э. Оптимизация технологии получения рHEMT-структур на подложках GaAs с профилем легирования в виде нанопиты из атомов олова № 5
- Сивченко А. С., Кузнецов Е. В. Методики анализа основных характеристик надежности в КМОП ИС с помощью тестовых структур в составе пластин № 6
- Спиринов В. Г. Конструкция и технология многоуровневой платы с полимерной изоляцией № 7
- Тимошенков С. П., Анчутин С. А., Плеханов В. Е., Кочурина Е. С., Тимошенков А. С., Зуев Е. В. Разработка математического описания кольцевого микрогирискапа № 5
- Тимошенков С. П., Анчутин С. А., Рубчиц В. Г., Зарянкин Н. М., Виноградов А. И., Дернов И. С., Кочурина Е. С. Особенности проектирования и изготовления чувствительного элемента микромеханического акселерометра на КНИ-структурах № 7
- Тютюгин А. В., Жукова С. А., Турков В. Е. Формирование проводящих микровыводов методом жидкостной химической обработки для сборки кристаллов методом "флип-чип" № 5

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Абдуллаев Д. А. Изменение набора примесных материалов при уменьшении топологических норм производства интегральных микросхем № 5
- Абдуллаев Д. А., Зайцев А. А., Кельм Е. А. Селективное плазменное травление нитрида кремния относительно оксида кремния № 2

- Аверин И. А., Пронин И. А., Мошников В. А. Димитров Д. Ц., Якушова Н. Д., Карманов А. А., Кузнецова М. В. Анализ каталитических и адсорбционных свойств *d*-металлов-модификаторов диоксида олова № 7
- Амеличев В. В., Благов Е. В., Костюк Д. В., Васильев Д. В., Беляков П. А., Орлов Е. П., Абанин И. Е., Тахов В. С., Руковишников А. И., Россуканый Н. М. Магниторезистивная микросистема контроля электрического тока в проводнике . . . № 1
- Бабаевский П. Г., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Гринькин Е. А., Турков В. Е., Резниченко Г. М., Рискин Д. Д., Бычкова Ю. А. Вакуумплотное матричное корпусирование сенсорных микроэлектромеханических систем (аналитический обзор). Часть 1. Процессы соединения и разрезания пластин, локальная герметизация (вакуумное капсулирование) чувствительных элементов сенсорных микроэлектромеханических систем . . № 3
- Бабаевский П. Г., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Гринькин Е. А., Турков В. Е., Резниченко Г. М., Рискин Д. Д., Бычкова Ю. А. Вакуумплотное матричное корпусирование сенсорных микроэлектромеханических систем (аналитический обзор). Часть 2. Формирование вакуумплотных электрических выводов, способы сохранения и контроля вакуума в рабочих полостях и общие тенденции развития технологии корпусирования с МЭМС № 4
- Белянин А. Ф., Самойлович М. И., Борисов В. В. Влияние термообработки углеродных пленок на характеристики автоэмиссионных катодов на их основе № 8
- Белянин А. Ф., Самойлович М. И., Борисов В. В., Евлашин С. А. Исследование многофазных углеродных пленок автоэмиссионных катодов методами электронной микроскопии, комбинационного рассеяния света и рентгеновской дифрактометрии № 2
- Березин В. М. Проявление квантового размерного эффекта в электросопротивлении тонких пленок углерода № 10
- Богданова Д. А., Булярский С. В., Басеев А. С. Изменение ширины НОМО-LUMO-щели одностенных углеродных нанотрубок при хемосорбции водорода № 6
- Брехов К. А., Лавров С. Д., Афанасьев М. С., Шерстюк Н. Э., Мишина Е. Д., Кимель А. В. Линейный электрооптический эффект в пленках BST: расчет коэффициента Керра . . . № 4
- Ваньков В. А., Земляников Н. С., Суханов В. С. Современные технологии и подходы создания миниатюрных приемопередающих модулей № 6
- Васильев В. Ю. Тренды развития методов химического осаждения из газовой фазы тонкопленочных материалов для прецизионных технологий № 9
- Вертянов Д. В., Тимошенков С. П., Петров В. С., Горюнова Е. П. Свойства и практическое применение полиимидных микроструктур № 11
- Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Мельников А. А., Несмелов С. Н., Коханенко А. П., Лозовой К. А. Технология создания структур с квантовыми точками Ge/Si молекулярно-лучевой эпитаксией № 9
- Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Мельников А. А., Несмелов С. Н., Коханенко А. П., Лозовой К. А. Современные методы создания структур с квантовыми точками Ge/Si . . № 10
- Волохов И. В. Исследование технологий получения многослойных гетероструктур с применением различных методов осаждения в вакууме изолирующих покрытий на корпусные элементы датчиков-преобразующей аппаратуры для авиационно-космической техники № 1
- Галиев Г. Б., Климов Е. А., Лаврухин Д. В., Ячменев А. Э., Галиев Р. Р., Пономарев Д. С., Хабибуллин Р. А., Федоров Ю. В., Бугаев А. С. Разработка и исследование фотопроводящих антенн на основе полупроводников группы АЗВ5, выращенных при пониженных температурах эпитаксиального роста . . № 6
- Галнерин В. А., Громов Д. Г., Лебедев Е. А., Шулятьев А. С., Смирнов Д. И., Шилиева Ю. И. Размерный эффект в многослойных тонкопленочных термитных материалах на основе композита алюминий — нитрид меди № 6
- Горнев Е. С., Янович С. И. Процесс реактивно-ионного травления контактных окон в смеси на основе C_4F_8 для технологии менее 0,25 мкм № 8
- Гринькин Е. А., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Тютюгин А. В., Турков В. Е. Кинетика травления неорганического "жертвенного" слоя при изготовлении чувствительных элементов инерциальных датчиков по технологии "Кремний-на-изоляторе" № 7
- Гурин С. А., Песков Е. В., Вергазов И. Р. Методика термостабилизации тонкопленочных гетерогенных структур № 11
- Демин Г. Д., Дюжев Н. А., Попков А. Ф., Чиненков М. Ю. Спин-поляризованная токовая эмиссия в вакуум и переключение магнитного состояния тонких nanoостровковых пленок . № 4
- Дибирова К. С., Козлов Г. В., Магомедов Г. М. Влияние кристаллической морфологии на формирование фрактального пространства для нанокомпозитов полимер/органоглина . . № 1
- Ерошкин П. А., Шешин Е. П. Электронная пушка с автоэмиссионным катодом для вакуумных приборов № 1
- Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Турков В. Е., Рискин Д. Д., Кудрявцев П. Н., Четверов Ю. С. Особенности технологии изготовления высокочувствительных неохлаждаемых микроболюметрических матриц № 5
- Заярский Д. А., Невешкин А. А., Байбури В. Б., Славовская Ю. П. Создание многослойных структур на основе Alq_3 и исследование их свойств № 4
- Зубов Д. Н., Кельм Е. А., Милованов Р. А., Молодцова Г. В. Электрохимическое восстановление поврежденных контактных площадок кристаллов при анализе отказов современных интегральных схем № 5
- Кутвицкий В. А., Сорокина О. В., Маслов Л. П., Толмачев В. А., Васильева М. А. Синтез гетероструктур на основе висмутсодержащих оксидных стекол и их использование в качестве сенсорных элементов для определения содержания сероводорода и водяных паров в воздушной среде № 2
- Ларичков А. В., Беклемишев В. И., Махонин И. И., Филиппов К. В. Формирование наноструктурных покрытий на поверхности трения машин и механизмов № 3
- Мухуров Н. И., Ефремов Г. И., Жвавый С. П. Электростатические микрокоммутаторы. Часть 3. Переключающие микрокоммутаторы № 1
- Побойкина Н. В. Использование алмаза в качестве теплоотводящего элемента: методы и устройства выращивания алмазных пленок и пластин № 3
- Рембеза С. И., Кошелева Н. Н., Рембеза Е. С., Свистова Т. В., Плотникова Е. Ю., Агапов Б. Л., Гречкина М. В. Многокомпонентные наноструктурированные пленки $(SnO_2)_x(ZnO)_{1-x}$ ($x = 0,5...1$) для газовой сенсорики и прозрачной электроники № 8
- Рехвиашвили С. Ш. О теплофизических свойствах идеального графена при низких температурах № 10
- Синев Л. С., Рябов В. Т. Расчет коэффициентных напряжений в соединениях кремния со стеклом № 9
- Соколов Л. В., Жуков А. А., Парфенов Н. М., Ануров А. Е. Анализ современных технологий объемного микропрофилирования кремния для производства чувствительных элементов датчиков и МЭМС № 10
- Тимошков Ю. В., Курмашев В. И., Тимошков В. Ю., Сакова А. А. Формирование прецизионных 3D-микроструктур методом LIGA-like-технологии для компонентов МЭМС № 10
- Томаш К. Н. Характеристики и использование ВЧ и СВЧ разрядов при создании твердотельных полупроводниковых приборов № 5
- Трегулов В. В., Гудзев В. В., Вишняков Н. В., Воробьев Ю. В., Толкач Н. М. Структура поверхности пленок пористого кремния, сформированных в электролите на основе HF с добавкой $KMnO_4$ № 11
- Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Романов А. В. Влияние внешних воздействий на сверхвысокочастотные характеристики композитных материалов с включениями из углеродных нанотрубок № 3

Федоров Ю. В., Михайлович С. В. Влияние параметров наногетероструктур и технологии изготовления на шумовые свойства AlGaIn/GaN HEMT № 10

Фирсова Н. Ю., Елшин А. С., Марченкова М. А., Болотов А. К., Иванов М. С., Пронин И. П., Сенкевич С. В., Киселев Д. А., Мишина Е. Д. Пересключаемость перовскитных микрообластей пленок ЦТС, локально отожженных фемтосекундным лазером инфракрасного диапазона № 7

Фрицлер К. Б., Селезнев В. А., Принц В. Я. Микро- и наноструктурированные тектон-адгезивы: формирование и практические применения № 4

Чуйко О. В., Кузнецов Е. В., Савельев М. И., Комарова Н. В., Сироткина М. С. Технология формирования интегральной микрофлюидной КМОП-системы с нанопроволочными чувствительными элементами № 6

Ячменев А. Э., Бугаев А. С., Федоров Ю. В., Хабибуллин Р. А., Пономарев Д. С., Галиев Г. Б. Разработка и исследование метаморфных InAlAs/InGaAs/InAlAs наногетероструктур на подложках GaAs для приборов миллиметрового диапазона длин волн № 8

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Акопян В. А., Захаров Ю. Н., Париню И. А., Лабанцев Ю. А., Рожков Е. В., Чебаненко В. А. Лабораторный образец испытательного стипда для определения характеристик активных элементов пьезоэлектрических генераторов осевого типа в режиме их низкочастотного импульсного нагружения № 10

Амеличев В. В., Генералов С. С., Сывороткин П. А., Шаманаев С. В., Платонов В. В. Устройство управления микромеханическим реле на основе массива силовых МЭМС-ключей № 2

Антонов А. А., Карпович М. С., Пичугин И. В., Курленко А. А., Васильев В. Ю. Интегральная микросхема драйвера "мягкой" коммутации силовых ключей для мощных источников электропитания № 6

Бурдин Д. А., Фетисов Ю. К., Чашин Д. В., Экономов Н. А. Датчик магнитных полей гетеродинамного типа на основе нелинейного магнитоэлектрического эффекта № 2

Васильев В. А., Москалев С. А., Ползунов И. В., Шоколов В. А. Полупроводниковые микроэлектромеханические системы современных и перспективных датчиков давления № 11

Галперин В. А., Громов Д. Г., Кишок Е. П., Маркеев А. М., Лебедев Е. А., Черникова А. Г., Дубков С. В. Суперконденсатор на основе УНТ с использованием псевдоемкости тонких слоев оксидов металлов № 6

Глинский И. А., Рубан О. А., Алешин А. Н., Зенченко Н. В., Мельников А. А. Расчет тепловых режимов HEMT-транзисторов на основе гетероструктуры AlGaIn/GaN № 11

Годовицын И. В., Генералов С. С., Поломошнов С. А., Сывороткин П. А., Амеличев В. В. Интегральный конденсаторный преобразователь акустического давления для миниатюрного МЭМС-микрофона № 4

Горох Г. Г., Захлебавая А. И., Белогунов Е. А., Хатько В. В., Таратын И. А. Химические газовые сенсоры на подложках из нанопористого оксида алюминия № 9

Гусев Д. В., Данилова Н. Л., Земляничников Н. С., Суханов В. С. Многоканальные тензорезистивные преобразователи давления № 6

Джашинов В. Э., Панкратов В. М. Блок микромеханических чувствительных элементов с реверсивной системой терморегулирования на модуле Пельтье № 3

Драгунов В. П., Доржиев В. Ю. Трехэлектродная двухконденсаторная МЭМС со встроенным зарядом № 2

Есман А. К., Кулешов В. К., Зыков Г. Л., Залесский В. Б. ИК приемник на основе перехода Шоттки с резонансными нано- и микроструктурами № 3

Макеев М. О., Иванов Ю. А., Мешков С. А., Синякин В. Ю. Исследования термической деградации резонансно-туннельных диодов на базе AlAs/GaAs-наногетероструктур № 12

Малашевич Н. И. Разработка методики интеграции ОЗУ в базовых матричных кристаллах космического назначения № 6

Мальцев П. П., Майтама М. В., Павлов А. Ю., Щаврук Н. В. Расчет и изготовление узкополосного СВЧ микроэлектромехани-

ческого переключателя для частотного диапазона 10...12 ГГц на подложках арсенида галлия № 6

Новиков С. Г., Гурии Н. Т., Беринцев А. В., Родионов В. А., Штанько А. А., Федоров И. С. Полупроводниковые приборы с S-образной передаточной вольт-амперной характеристикой № 7

Новиков Ю. А. Виртуальные измерительные приборы № 11

Платонов К. В. Микросборки с встроенными пассивными компонентами на кремниевой подложке № 6

Раснонов В. Я., Малютин Д. М., Иванов Ю. В., Грязни Д. Г. Система ориентации на микромеханических акселерометрах № 9

Семенов А. Н., Шалимов А. С., Зуев Е. В. Исследование возможности создания на БМК 5503 микросхемы емкостного преобразователя линейного ускорения № 11

Синев И. В., Смирнов А. В., Гребенников А. И., Сякина С. Д., Симаков В. В., Кисин В. В. Влияние предварительного нагрева на распознавательную способность мультисенсорной микросистемы № 1

Суханов А. В., Прокофьев И. В., Гусев Д. В. Мультиагентная система мониторинга web-датчиков, созданная на основе наносенсорики № 6

Сякина С. Д., Синев И. В., Смирнов А. В., Симаков В. В. Электрохимический импеданс газочувствительных микросистем на основе поликристаллических слоев диоксида олова № 10

Тимошенков С. П., Шерченков А. А., Нальский А. А., Ревина А. А., Лобус Р. Е. Источник тока на фотоэлектрическом эффекте с повышенными показателями эффективности № 11

Турков В. Е., Жукова С. А., Рискин Д. Д., Бабаевский П. Г., Резниченко Г. М. Реактивные микродвигатели, изготавливаемые по технологии МСТ № 12

Федоров Р. А. Микросхема управления модулем радиационной защиты № 6

БИОЭЛЕКТРОНИКА

Игнатов И. И., Мосин О. В. Методы получения наночастиц коллоидного серебра № 2

Игнатов И. И., Мосин О. В. Структурные модели воды, описывающие циклические нанокластеры № 3

Игнатов И. И., Мосин О. В. Эффект Кириана в изучении газоразрядного свечения биологических объектов и воды № 12

СИСТЕМА-НА-КРИСТАЛЛЕ

Беляев С. В., Шаманаев П. А., Щербаков С. В. Программный модуль конфигурирования SnK № 6

Вишнеков А. В., Ерохин В. В. Проектирование систем-на-кристалле: выбор базовой технологии изготовления кристалла № 4

Вишнеков А. В., Ерохин В. В., Иванова Е. М. Верификация СНК: выбор стратегии № 12

ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

Бабуров В. А., Томаш К. Н., Павлов В. Ю. Модульная система дистанционного обучения и тестирования специалистов в области плазмохимических процессов № 11

Денисова Е. В., Насыбуллаева Э. Ш., Насыбуллаев И. Ш., Мурашкин М. Ю. Применение наноструктурных материалов в топливной автоматике № 8

Смирнов А. В., Гребенников А. И., Грибов А. Н., Симаков В. В., Синев И. В., Кисин В. В. Отклик газочувствительной микросистемы на запах перегретой изоляции электрического кабеля № 2

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ

Раткин Л. С. К тридцатилетию Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук: фундаментальные и прикладные аспекты разработки нано- и микросистемной техники № 5

Раткин Л. С. Современные импортозамещающие технологии: от квантовой наноэлектроники — к компьютерной стеганографии № 12

Сигейкин Г. И., Барачевский В. А., Прудников Н. В. Фотоника и нанофотоника: состояние и перспективы № 8

INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL "NANO AND MICROSYSTEM TECHNIQUE" IN 2014

GENERAL QUESTIONS

- Rathkeen L. S.** Synchrotron & Neutron Researching of Nanosystems. № 1
- Rathkeen L. S.** Towards the Jubilee of National Scientific & Research Center "Kurchatov Institute": New Works in the Field of Nano- & Micro-System Technique. № 2

NANOTECHNOLOGY AND SCANNING PROBE MICROSCOPY

- Aleksandrov P. A., Budaragin V. V., Guk V. I., Litvinov V. L.** On Fault Tolerance of Nanoelectronic Integrated Circuits under Irradiation. № 1
- Barkaline V. V., Chashynski A. S.** Hydrogen Adsorption on Carbon Nanotubes with Interaction in Adsorbed Phase № 2
- Galushka V. V., Bilenko D. I., Terin D. V.** Controlled Study of Mass Transfer in Nanostructures AgI-Ag by Tunneling Microscope Method. № 8
- Glukhova O. E., Kolesnikova A. S., Slepchenkov M. M.** Terahertz Emitter Based on Single-Walled Nanotube Filled with Fullerenes № 10
- Samoylovich M. I., Bovtun V., Belyanin A. F., Nuzhnyy D., Kempa M., Klesheva S. M., Savinov M.** Dielectric Properties of the Opal Matrix with Filled Interspherical Nanospacing Zinc Oxide № 7
- Sheshin E. P., Kolodyazhnyy A. Yu., Obiedkov A. M., Ketkov S. Yu., Kremlev K. V., Kaverin B. S., Semenov N. M.** Investigation of Field Emission Properties of Radial-Oriented Multiwall Carbon Nanotube Arrays. № 10
- Vorobjova A. I., Prischepa S. L., Utkina E. A., Komar O. M.** Formation and Properties of Nickel Nanopillars in Porous Aluminum Oxide № 1
- Yakh'yeva Kh. Sh., Kozlov G. V., Magomedov G. M.** The Dependence of Interfacial Adhesion Level on Carbon Nanotubes (Nanofibers) Ring-Like Structures Radius № 8

MODELLING AND DESIGNING OF MNST

- Abramov I. I., Kolomeitseva N. V., Labunov V. A., Romanova I. A., Basaev A. S.** Simulation of Hybrid Integrated Structures Based on Carbon Nanotubes № 5
- Afonin S. M.** Decision Wave Equation for Electromagnitoclastic Tasks of Actuators for Nano- and Microdisplacement № 2
- Amelichev V. V., Generalov S. S., Yakukhina A. V., Shamanaev S. V., Platonov V. V.** The Design and Technology of the Matrix of Power Microelectromechanical Keys № 3
- Artemova A. I., Mikhailov Y. A., Pankov V. V., Sukhanov V. S.** Optimization of Pressure Sensing Element Construction with Distributed Rigid Center Using 3D-Computer Modeling. № 6
- Artemova A. I., Mikhailov Y. A., Pankov V. V., Sukhanov V. S.** Optimization of Pressure Sensing Element Construction with Distributed Rigid Center Using 3D Computer Modeling. № 7
- Despotuli A. L., Andreeva A. V.** Maxwell Displacement Current and "Universal" Dynamic Response in Nanoionics. № 5
- Dzhashitov V. E., Pankratov V. M., Golikov A. V.** Mathematical Modeling of Thermal Processes in Carbon Nanotubes and Fullerenes № 11
- Galperin V. A., Razzhivin N. A.** Research of the Plasma Gate Resist Trimming Processes № 6
- Glukhova O. E., Kolesnikova A. S., Slepchenkov M. M., Shmygin D. S.** Motion Control Phospholipids in the Electric Field № 7
- Gridchin V. A., Vasilyev V. Y., Chebanov M. A., Byalik A. D., Chernov A. S.** A numerical simulation of the photoelectric fiber optic pressure sensor components. № 6
- Ignatov I. I., Mosin O. V.** Color Coronal Kirlian Spectral Analysis in Modeling of Non-Equilibrium Conditions with the Gas Electric Discharges, Simulating Primary Atmosphere № 8

- Makarceva M. M.** Study of Efficiency for Design Automation Using Library of Fault Tolerant Cells with Redundancy. № 11
- Maltsev P. P., Matveenko O. S., Fedorov Y. V., Gnatyuk D. L., Krapukhin D. V., Zuev A. V., Bunegina S. L.** 5 mm-Wave Amplifier Monolithic Integrated Circuit with Integrated Antenna № 9
- Markelov A. S., Trushin V. N., Chuprunov E. V.** Investigation the Possibility Formation of the Spatial Structure of X-Ray Beams with Use the Doped Crystals № 4
- Molodtsova G. V., Milovanov R. A., Zubov D. N., Kelm E. A.** Approaches to a Die Decoupling during Failure Analysys of the 3D Package Integrated Circuits № 7
- Podgornyy Yu. V., Vorotilov K. A., Lavrov P. P., Sigov A. S.** Current-Voltage Dependencies of Porous PZT Films № 9
- Pronin I. A., Averin I. A., Dimitrov D. Tz., Karmanov A. A.** Peculiarities of Structure and Synthesis Model Nanocomposites Composite Materials Composition $\text{SiO}_2\text{—Me}_x\text{O}_y$, Obtained with the Sol—Gel Technology № 8
- Pronin I. A., Averin I. A., Moshnikov V. A., Yakushova N. D., Kuznetsova M. V., Karmanov A. A.** Percolation Model Based Gas Sensors Semiconductor Oxide Nanomaterials with Hierarchical the Pore Structure № 9
- Roslyakov A. S.** Feasibility Study for Low Power IP Blocks for the Solution of Finite-Difference Equations in Low-Frequency Signal Conversions № 6
- Sapogin V. G., Prokopenko N. N., Marchuk V. I., Manzhlva V. G., Budyakov A. S.** Inductive Properties of Microscopic Conducting Ring with Density of Rotational Current of Azimuth Direction. № 1
- Senichkin A. P., Bugaev A. S., Jachmenev A. E.** Optimization of pHEMT Producing Technology on the GaAs Substrates with Doping Profile in the Form of Sn Nanowires. № 5
- Senichkin A. P., Bugaev A. S., Yachmenev A. E.** Investigation of the Current Instability Appearing while Apply Direct Current Perpendicularly to the Nanowires Inserted in the GaAs Crystal № 3
- Sivchenko A. S., Kuznetsov E. V.** Methods of Analysis of the Main Characteristics of a CMOS IC Reliability Using Test Structures on Wafers. № 6
- Spirin V. G.** Design and Technology of the Layered Charge with Polymeric Insulation № 7
- Timoshenkov S. P., Anchutin S. A., Plekhanov V. E., Kochurina E. S., Timoshenkov A. S., Zuev E. V.** Development of Mathematical Descriptions of the Micromechanical Ring Gyroscope № 5
- Timoshenkov S. P., Anchutin S. A., Rubchic V. G., Zaryankin N. M., Vinogradov A. I., Dernov I. S., Kochurina E. S.** Features of the Design and Manufacturing of Micromechanical Accelerometer Sensor for SOI Structures № 7
- Tyutyugin A. V., Zhukova S. A., Turkov V. E.** Bump Formation by Liquid Chemical Treatment for Flip-Chip Technology № 5
- Vinokurov D. L.** Numerical Simulations of Magnetic Structure at the Compensated Ferromagnet — Multiferroic Interface № 4
- Vishnekov A. V., Erokhin V. V., Ivanova E. M.** Automation of Microcontroller Choice Procedure № 7
- Zenchenko N. V., Ruban O. A., Aleshin A. N., Glinskiy I. A., Melnikov A. A.** Simulation of Nonstationary HEMT-Transistor Thermal Modes. № 12

SCIENCE OF MATERIALS AND TECHNOLOGICAL BASICS OF MNST

- Abdullaev D. A.** Change Set of Applied Materials at Reduction Topological Norms Production of Integrated Microcircuits. № 5
- Abdullaev D. A., Zaitsev A. A., Kelm E. A.** Selective Plasmochemical Etching of Silicon Nitride to Silicon Oxide № 2
- Amelichev V. V., Blagov E. V., Kostyuk D. V., Vasilyev D. V., Belyakov P. A., Orlov E. P., Abanin I. E., Takhov V. S., Rukovichnikov A. I., Rossukanyy N. M.** Magnetoresistive Control Microsystem of Current and Current Fluctuations № 1

- Averin I. A., Pronin I. A., Moshnikov V. A., Dimitrov D. Tz., Yakushova N. D., Karmanov A. A., Kuznetsova M. V. Analysis Catalytic and Adsorption Properties of D-Modifier Metal Tin Dioxide № 7
- Babayevsky P. G., Zhukova S. A., Obizhaev D. Y., Grinkin E. A., Turkov V. E., Reznichenko G. M., Riskin D. D., Bychkova Y. A. MEMS Sensor Vacuum Wafer Level Packaging (Analytical Review). Part 1. Wafer Bonding and Dicing Technologies, Local Hermetic Sealing (Vacuum Encapsulation) of MEMS Sensor Sensitive Elements № 3
- Babayevsky P. G., Zhukova S. A., Obizhaev D. Yu., Grinkin E. A., Turkov V. E., Reznichenko G. M., Riskin D. D., Bychkova Y. A. MEMS Sensor Vacuum Wafer Level Packaging (Analytical Review). Part 2. Vacuum-Tight Electrical Interconnection Formation, Practice of Vacuum Preservation and Control in Working Cavities and General Tendencies of Development of MEMS Sensor Vacuum Wafer Level Packaging № 4
- Belyanin A. F., Samoylovich M. I., Borisov V. V. The Effect of Heat Treatment of the Carbon Films on Characteristics of Field Emission Cathodes on their Base № 8
- Belyanin A. F., Samoylovich M. I., Borisov V. V., Evlashin S. A. Study of Multiphase Carbon Films of Field Emission Cathodes Electron Microscopy, Raman Spectroscopy and X-Ray Diffraction Methods № 2
- Berezin V. M. The Manifestation of Quantum Size Effect in Electrical Conductance Thin Films of Carbon № 10
- Bogdanova D. A., Bulyarskii S. V., Basaev A. S. The Modification of HOMO-LUMO Gap of Single-Walled Carbon Nanotubes under the Hydrogen Chemisorption № 6
- Brekhov K. A., Lavrov S. D., Afanasiev M. S., Sherstyuk N. E., Mishina E. D., Kimel A. V. Linear Electrooptical Effect In BST Films: Kerr Coefficient Calculation № 4
- Chuyko O. V., Kuznetsov E. V., Saveliev M. I., Komarova N. V., Sirotkina M. S. Technology Integrated CMOS Microfluidic Systems with Nanowire Sensing Elements № 6
- Demin G. D., Djuzhev N. A., Popkov A. F., Chinenkov M. Yu. Spin-Polarized Field Emission and Current-Induced Magnetization Switching of Nano-Island Magnetic Thin Films № 4
- Dibirova K. S., Kozlov G. V., Magomedov G. M. The Influence of Crystalline Morphology on Fractal Space Formation for Nanocomposites Polymer/Organoclay № 1
- Eroshkin P. A., Sheshin E. P. Electron Gun with Field Emission Cathode for Vacuum Tubes № 1
- Fedorov Yu. V., Mikhaylovich S. V. The Effect of Nanoheterostructure Parameters and Fabrication Technology on the Noise Properties of AlGaIn/GaN HEMT № 10
- Firsova N. Yu., Elshin A. S., Marchenkova M. A., Bolotov A. K., Ivanov M. S., Pronin I. P., Senkevich S. V., Kiselev D. A., Mishina E. D. Switching of Perovskite Micro Regions in Amorphous PZT Thin Films, Annealed with Femtosecond IR Laser № 7
- Fritzler K. B., Seleznev V. A., Prinz V. Ya. Micro- and Nanostructured Gecko — Inspired Adhesives: Fabrication and Applications № 4
- Galiev G. B., Klimov E. A., Lavrukin D. V., Yachmenev A. E., Galiev R. R., Ponomarev D. S., Khabibullin R. A., Fedorov Yu. V., Bugaev A. S. Fabrication and Investigation of the Photoconductive Antennas Based on A3B5 Semiconductors Grown by MBE with the Low-Temperature Regime № 6
- Galperin V. A., Gromov D. G., Lebedev E. A., Shulyatiev A. S., Smirnov D. I., Shilyaeva Yu. I. Size Effect in Multilayer Thin Film Thermite Materials Based on Aluminum-Copper Nitride Composite № 6
- Gornev E. S., Yanovich S. I. Sub-Quarter Micron Process Node Contacts Reactive Ion Etching with C_4F_8 Based Gas Mixtures № 8
- Grinkin E. A., Zhukova S. A., Obizhaev D. Yu., Tyutyugin A. V., Turkov V. E. Kinetics of Inorganic Sacrificial Layer Etching in the Manufacture of Inertial Sensors Sensing Elements using "Silicon-On-Insulator" Technology № 7
- Gurin S. A., Peskov E. V., Vergazov I. R. Methods of Temperature Setting for Thin Film Heterogeneous Structures № 11
- Kutvistkiy V. A., Sorokina O. V., Maslov L. P., Tolmachev V. A., Vasilyeva M. A. The Synthesis of the Heterostructures Based on the Bismuth-Containing Oxide Glasses and their Usage in the Capacity of Sensing Elements for the Hydrogen Sulphide and Water Vapours Determination № 2
- Larchikov A. V., Beklemyshev V. I., Makhonin I. I., Filippov K. V. Formation of Nanostructured Coatings on the Friction Surfaces of Machines and Mechanisms № 3
- Mukhurov N. I., Efremov G. I., Zhvayyi S. P. Electrostatic Micro Switches. Part 3. Closing-Shutdown Micro Switches № 1
- Poboykina N. V. The Use of Diamond as a Heat Sink Element: Methods and Devices of Growing Diamond Films and Plates № 3
- Rekhviashvili S. Sh. Thermophysical Properties of Ideal Graphene at Low Temperatures № 10
- Rembeza S. I., Kosheleva N. N., Rembeza E. S., Svistova T. V., Plotnikova E. Yu., Agapov B. L., Grechikina M. V. Multicomponent Nanostructured Films $(SnO_2)_x(ZnO)_{1-x}$ ($x = 0,5...1$) for Gas Sensors and Transparent Electronic № 8
- Sinev L. S., Ryabov V. T. Coefficient of Thermal Expansion Mismatch Induced Stress Calculation for Field Assisted Bonding of Silicon to Glass № 9
- Sokolov L. V., Zhukov A. A., Parfenov N. M., Anurov A. E. Analysis of Modern Technologies Surround Microproteinuria Silicon for the Production of Sensitive Elements of Sensor and MEMS № 10
- Timoshkov Yu. V., Kurmashev V. I., Timoshkov V. Yu., Sakova A. A. Precision 3D-Microstructures by Liga-Like Technology for MEMS Components № 10
- Tomosh K. N. Characteristics of Microwave and High Frequency While Fabricating Semiconductor Devices № 5
- Tregulov V. V., Gudzev V. V., Vishnyakov N. V., Vorobjov Y. V., Tolkach N. M. The Surface of Porous Silicon Films Formed by $(HF + KMnO_4)$ Electrolyte № 11
- Usanov D. A., Skripal A. V., Romanov A. V. Effect of the External Influences on the Microwave Characteristics of the Composite Materials with Inclusions Made of Carbon Nanotubes № 3
- Vankov V. A., Zemlyannikov N. S., Sukhanov V. S. State-of-Art Technologies and Approaches for Transceiver Modules Implementation № 6
- Vasilyev V. Yu. Trends of Thin Film Chemical Vapor Deposition Methods for Precision Technologies Applications № 9
- Vertyanov D. V., Timoshenkov S. P., Petrov V. S., Goryunova E. P. Properties and Practical Application of Polyimide Microstructures № 11
- Voitsekhovskii A. V., Kulchitskii N. A., Melnikov A. A., Nesmelov S. N., Kokhanenko A. P., Lozovoy K. A. Creation of Structures with Ge/Si Quantum Dots by the Method of Molecular Beam Epitaxy № 9
- Voitsekhovskii A. V., Kulchitskii N. A., Melnikov A. A., Nesmelov S. N., Kokhanenko A. P., Lozovoy K. A. Modern Methods of Creation of Structures with Ge/Si Quantum Dots № 10
- Volokhov I. V. Study of Technologies for Producing Multilayer Heterostructures Using Different Methods Vacuum Deposition of Insulating Coatings on the Hull of the Sensor Elements, Transforming Equipment for Aerospace Engineering № 1
- Yachmenev A. E., Bugaev A. S., Fedorov Yu. V., Khabibullin R. A., Ponomarev D. S., Galiev G. B. Fabrication and Investigation of Metamorphic InAlAs/InGaAs/InAlAs Nanoheterostructures Based on GaAs Wafers for Mm-Wave Band Devices № 8
- Zayarski D. A., Neveshkin A. A., Baiburin V. B., Slapovskaya Yu. P. Multilayer Structures Based on Alq3: the Creation and Study of Their Properties № 4
- Zhukova S. A., Obizhaev D. Yu., Turkov V. E., Riskin D. D., Kudryavtsev P. N., Chetverov Yu. S. Technology Features of High-Sensitive Uncooled Microbolometric Arrays Manufacturing № 5
- Zubov D. N., Kelm E. A., Milovanov R. A., Molodtsova G. A. Electrochemical Recovery of Damaged Bonding Area During Failure Analysis of the Modern Integrated Circuits № 5